

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

MICHIO YANAGI ET AL.

Application No.: 09/742,415

Filed: December 22, 2000

For: METALLIC MIRROR, METALLIC)
POLYGONAL MIRROR, AND
PROCESS FOR THEIR
PRODUCTION

April 5, 2001

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

CLAIM TO PRIORITY

Sir:

Applicants hereby claim priority under the International Convention and all rights to which they are entitled under 35 U.S.C. § 119 based upon the following Japanese Priority Applications:

11-368036, filed December 24, 1999 2000-020269, filed January 28, 2000

A certified copy of the priority documents are enclosed.

Applicants' undersigned attorney may be reached in our New York office by telephone at (212) 218-2100. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,

Attorney for Applicants

Registration No.

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO 30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3801
Facsimile: (212) 218-2200

NY_MAIN 159312 v 1



日

本国特許庁

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

1999年12月24日

出顯番号

Application Number:

平成11年特許願第368036号

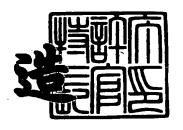
キヤノン電子株式会社

2001年 1月12日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office







特平11-368036

【書類名】 特許願

【整理番号】 4059029

【提出日】 平成11年12月24日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G02B 26/10

【発明の名称】 金属回転多面鏡

【請求項の数】 2

【住所又は居所】 埼玉県秩父市大字下影森1248番地 キヤノン電子株

式会社内

【氏名】 柳 道男

【住所又は居所】 埼玉県秩父市大字下影森1248番地 キヤノン電子株

式会社内

【氏名】 高岡 智志

【特許出願人】

【識別番号】 000104652

【氏名又は名称】 キヤノン電子株式会社

【代理人】

【発明者】

【発明者】

【識別番号】 100088328

【弁理士】

【氏名又は名称】 金田 暢之

【電話番号】 03-3585-1882

【選任した代理人】

【識別番号】 100106297

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 克博

【選任した代理人】

【識別番号】 100106138

【弁理士】

【氏名又は名称】 石橋 政幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 089681

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 金属回転多面鏡

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アルミニウムまたはその合金からなる回転多面鏡基体上に、 TiO_2 からなる中間層と、Cuからなる金属反射層とが順次積層された金属回転多面鏡。

【請求項2】 前記金属反射層の上に、さらに1層以上の保護層が形成されている請求項1記載の金属回転多面鏡。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、複写機、ファクシミリ、レーザービームプリンタなどの反射鏡として用いられる金属回転多面鏡に関し、特に環境安定性に優れ、反射率の安定性が高い、高反射率の金属多面鏡に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

従来、金属回転多面鏡としては次に説明する(a)、(b)、(c)等のものが知られている。

[0003]

(a) アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる回転多面鏡基体の切削鏡面を陽極酸化して透明皮膜を生成し、鏡面保護膜としたもの(特開昭58-184903号公報)。

[0004]

(b) アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる回転多面鏡基体上に、真空蒸着法によりCrからなる金属薄膜を形成し、その上にさらに真空蒸着法によりCuからなる高反射率金属薄膜を形成したもの(特開昭60-195502号公報)。

[0005]

(c) アルミニウムまたはアルミニウム合金からなる回転多面鏡基体上に真空

蒸着法により順次、中間層として膜厚が $50nm\sim100nm$ のCr層、金属反射層として $100nm\sim150nm$ のCu層、保護層として膜厚が $150nm\sim200nm$ の $A1_2O_3$ 層としたもの(特開平6-208076号公報)。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

上記従来技術のうち、(a)は平均反射率は約85%であって、複写機やレーザービームプリンタなどの高速化を図るためには十分な反射率とはいえず、さらにアルミニウムやアルミニウム合金からなる基体に陽極酸化膜を形成する場合、Si等の不純物が回転多面鏡基体に存在すると、陽極酸化膜にピット状の欠陥が生じる恐れがあるので、前記アルミニウムやアルミニウム合金は高純度のものにする必要があるため回転多面鏡基体材料の価格が高くなりコスト高となってしまう。

[0007]

また、(b)、(c)は、反射率は高くなるが、本発明者の検討によれば、中間層としてCr層、反射層としCu層を積層した構造は、次に示すように耐環境安定性の点で改良が必要である。

[0008]

即ち、本発明者は、アルミニウム基体上に、中間層としてCr層、反射層としCu層、保護層として $A1_2O_3$ 層および SiO_2 層を積層した金属回転多面鏡を、高湿度環境(45℃,95%RH,100時間, O_31 ppm;70℃,85%RH,100時間, O_31 ppm)に置いた後、に表面を観察したところ、図 6および図7(どちらも腐食部の光学顕微鏡写真)、図8(腐食部のFIB(focused ion beam)断面写真)に示すように、腐食が発生していた。

[0009]

この原因は、図5に模式的に示すように、金属の溶解反応と酸素の還元反応が起きて局部電池を形成していることによると考えられる。この反応が起こるきっかけは、膜表面に吸水性のゴミが付着し、そのごみが吸水性の場合、水分が局所的に浸入する。さらに水に溶けている溶存酸素も加わって最表層からSiO₂→

 $A \ 1_2 \ O_3 \rightarrow C \ u \rightarrow C \ r$ と通過して下地の $A \ 1$ まで達する。その結果、 $A \ 1$ の酸化物が形成され $A \ 1_2 \ O_3$ となり体積膨張を起こして膜を隆起させて不良となる。

[0010]

この現象は、以下の式に示す様な酸化還元反応で説明できる。

陽極:A1→A1³⁺+3e⁻

(A1の溶解反応)

陰極:O₂+2H₂O+4e⁻→4OH⁻ (酸素の還元反応)

さらに、図9(FIB断面写真)、図10~図12(光学顕微鏡写真)に示すように「膜浮き現象」が発生することがある。断面写真を見ると中間層のCr膜と反射層のCu膜間で剥離していることが分かった。Cr膜、Cu膜、Al₂O₃膜の各膜の応力を測定すると(測定方法は後述)、

Cr膜: +4. 15×10⁸Pa、

Cu膜: +1. 53×10⁸Pa、

 $A1_2O_3$ 膜: -0.63×10^8 Pa

であり、Cr膜とCu膜の応力差が大きいことがわかる。

[0011]

即ち、Cr膜とCu膜の応力差が膜浮き現象の原因となっており、さらに腐食についてもCr膜とCu膜の間の密着の悪い部分に水分が集まって腐食反応が始まると考えられる。

[0012]

本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであって、耐環境性に優れた高反射率を有する金属回転多面鏡を提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】

本発明は、アルミニウムまたはその合金からなる回転多面鏡基体上に、TiO2からなる中間層と、Cuからなる金属反射層とが順次積層された金属回転多面鏡に関する。

[0014]

このとき、前記金属反射層の上に、さらに1層以上の保護層が形成されている ことが好ましい。 [0015]

【発明の実施の形態】

本発明者は、アルミニウム回転多面鏡基体の耐湿保護、各層での応力のバランス、さらに多面鏡としての基本的特性である反射率等の観点から種々検討した結果、本発明に至ったものである。

[0016]

即ち本発明では、アルミニウムまたはアルミニウム合金製の回転多面鏡基体の 鏡面と高反射率の金属反射層であるCu膜との間に、中間層として設けたTiO2薄膜が、高湿度環境における膜最表層からの水分および酸素の浸入を防止して いると考えている。その結果、基体であるアルミニウム,アルミニウム合金が酸 化して $A1_2O_3$ に変化して体積膨張を起こし膜を持ち上げる腐食不良を抑えるこ とが可能となった。

[0017]

また、各膜の応力を測定したところ、

TiO₂膜: +0.30×10⁸Pa、

Cu膜: +1. 53×10⁸Pa、

 $A1_{2}O_{3}$ 膜: -0. 63×10^{8} Pa

であった。従来中間層として用いられていたCr膜の応力が+4. 15×10⁸ Paであるのに比べ、本発明の構成では、各膜の応力のバラツキを小さくなり、それにより「膜浮き現象」が抑えられていると考えられる。またそれにより、腐食も効果的に抑えられていると考えられる。

[0018]

ここで、応力の測定は、ガラス基板上に各膜を単膜に成膜してその反りから求めるStoneyの方法により、次の式

応力 $\sigma = E s D^2 / (6 (1 - \nu) R)$

から算出した。ここで

Es:基板のヤング率、

D:基板の厚さ

ν:基板のポアソン比

R:反りの曲率半径

であり、+が引っ張り方向、-が圧縮方向である。

[0019]

次に、図面を参照しながら本発明を説明する。

[0020]

図1は、本発明の金属回転多面鏡の1例の約半分を示す模式断面図である。図 1に示すようにアルミニウム製またはアルミニウム合金製の回転多面鏡基体1の 周面には切削加工等により鏡面が形成されている。ここでは、8面体の金属回転 多面鏡の例を示しているが、8面体以外の多面体であっても構わない。

[0021]

このままの状態では、反射率も86%前後で不十分であり、また基体の耐食性も十分とは言えない。そこで、本発明では、この金属多面鏡基体1の上にTiO2からなる中間層2と、Cuからなる金属反射層3を設ける。Cu金属反射層3は、基体金属(即ちアルミニウムまたはアルミニウム合金)よりも高反射率であり、それにより金属回転多面鏡としての反射率を高めることができる。本発明では、TiO2中間層2を設けることで、基体金属の鏡面の腐食を防止し、基体と高反射率の金属反射層との密着性を向上させる。

[0022]

本発明においてTiO2からなる中間層の厚さは、薄すぎると耐久性が不十分であり、厚すぎると成膜に時間がかかり生産性が悪くなるので、通常は、20nm~200nm、好ましくは50nm~150nm、最も好ましくは50nm~100nmである。尚、本出願において、膜厚は、特に明示しない限り機械膜厚である。

[0023]

また、Cuからなる金属反射層の厚さは、薄すぎると反射率が不十分になり、また厚すぎると成膜に時間がかかり生産性が悪くなるので、通常は、80nm以上、好ましくは80nm~150nm、最も好ましくは80nm~100nmである。

[0024]

TiO₂中間層およびCu金属反射層の形成方法は、特に制限はないが、蒸着 法が好ましく、この蒸着法には、真空蒸着法(狭義)、スパッタリング法および イオンプレーティング法等が含まれる。尚、Cu膜についてはメッキ等のウェッ ト成膜法も適用できるが、通常は蒸着法の方が好ましい。

[0025]

本発明では、鏡面の保護のために、さらに必要により増反射の目的を兼ねて、 金属反射層の表面に1層以上の保護層が設けられていることが好ましい。この保 護層は、通常、透明な誘電体材料で形成される。保護機能を高めるため、あるい は増反射の効果を高めるために、さらに複数の層としてもよい。特に、金属反射 層側から、低屈折率と高屈折率の誘電体材料が交互に成膜されていると、高反射 率が得られやすいので好ましい。

[0026]

低屈折率の誘電体材料としては、 MgF_2 、 SiO_2 、 Al_2O_3 等を挙げることができる。高屈折率の誘電体材料としては、 ZrO_2 、 TiO_2 、 CeO_2 、 SiO_2 が好ましい。また、このときの各保護層の膜厚は所望の波長で反射率が最大で、入射光に対する角度依存性が最小になるように最適化を図ることが好ましい

[0027]

誘電体の保護層の形成方法は、通常は真空蒸着法(狭義)、スパッタリング法 およびイオンプレーティング法等が含まれる蒸着法が好ましい。

[0028]

図1は、保護層が2層の例であり、金属反射層3の表面に保護層4、保護層5 が積層されている。また、図2の例では、保護層が3層であり、回転多面鏡基体 6の表面に、中間層7、金属反射層8、保護層9、保護層10、保護層11が順 に積層されている構造である。

[0029]

【実施例】

<中間層材料の評価試験>

「膜構成を、A1基体側から、A1/中間層/Cu/A1₂O₃/SiO₂として

中間層としての材料評価を行った。

[0030]

[0031]

その上にCu膜を約100nm積層して金属反射層を形成し、さらにその上に保護層として $A1_2O_3$ 薄膜を170nm、最表層の保護層に SiO_2 膜を14nm成膜した。 $A1_2O_3$ 、 SiO_2 は、 O_2 分圧 1.5×10^{-4} Torrで成膜した

[0032]

そして、各々の金属回転多面鏡を70 \mathbb{C} 、85 \mathbb{C} R H、 O_3 濃度 1 \mathbb{C} \mathbb{C} 即気で 10 \mathbb{C} の時間放置して耐環境特性を調べた。その結果を、表 1 と表 2 にまとめて示す。

[0033]

【表1】

表1_各中間層材料の腐食状況、反射率

				反射率(15° S偏光)					
	腐食状況		耐久試験前		耐久試験後				
中間層材質	免生数/検査数	発生率	855nm	675nm	780nm	655nm	675nm	780nm	密着
Cr	125/190	65.8	96.5	96.5	97.2	97.0	97.1	97.0	0
無し	13/20	65.0	94.7	95.6	96.7	93.0	94.3	96.6	×
Ni	12/20	60.0	88.4	90.9	95.4	84.3	87.3	92.7	0
Ti	10/20	50.0	95.4	95.7	96.7	93.2	94.2	98.5	Ō
Ni-Cr(20)	2/20	10.0	96,2	96.5	97.2	96.3	96.5		Ŏ
Cr2O3(O2有り)	3/60	5.0	85.8	89.1	94.5	82.2	86.6		Ö
Cr2O3(O2無)	12/60	20.0	94.6	95.9	98.8	94.3	95.4	98.9	0
ZrO2/TiO2(O2有り)	11/80	13.8	91.5	92.9	95.8	91.5	92.9	95.8	Ö
ZrO2(O2有り)	7/60	11.7	91.1	94.0	96.3	90.4	92.7	96.7	Ō
AI2O3(O2無)	4/20	20.0	94.7	95.8	96.6	94.0	94.7	96.8	Ö
SiO2(O2有り)	7/20	35.0	91.7	93.3	98.0	91.0	93.0	96.4	0
Ta2O5(O2有り)	8/20	40.0	94.3	95.5	97.0	95.3	96.5	97.0	Ŏ
Ta2O5(O2無)	11/60	18.3	94.5	95.7	98.9	95.3	96.1	97.0	Ö
TiO2(O2有り)	6/180	3.3	95.5	96.1	97.1	95.4	96.3	97.7	0

[0034]

【表2】

表2 各中間層材料の膜浮き現象発生率

中間層材質	良浮き現象発生率 発生数/検査数	発生率	拭き強度試験
Cr	45/190	23.7	0
無し	9/20	45.0	0
Ni Ti	8/20	40.0	0
Ti	7/20	35.0	0
Ni-Cr(20)	6/20	30.0	0
Cr2O3(O2有り)	0/60	0.0	0
Cr2O3(O2無)	0/60	0.0	0
ZrO2/TiO2(O2有り)	4/80	5.0	0
ZrO2(O2有り)	3/60	5.0	0
Al2O3(O2無)	1/20	5.0	_ 0
SiO2(O2有り)	2/20	10.0	0
Ta2O5(O2有り)	0/20	0.0	0
Ta2O5(O2無)	2/60	3.3	0
TiO2(02有り)	0/180	0.0	0

[0035]

表中の腐食状況については、耐久試験前後の鏡面の外観による変化が少しでも発生していれば、腐食発生ありとしてカウントした。また、密着テストは、粘着テープ (ニチバン社製)を金属回転多面鏡の表面に密着させ、20mm/secの速さで引き剥がし、前記表面の剥離の有無を目視で確認した。表面強度については、レンズクリーニングペーパー(ダスパーを使用)に溶剤(エーテル50vo1%,メタノール50vo1%)を浸透させ、上記クリーニングペーパーを金属回転多面鏡表面に、2kg/cm²の圧力で押し当てて10往復した後、表面のキズの有無を目視で確認した。

[0036]

表1、表2から、次のことがわかる。

- ①基体素材と金属反射層の密着は中間層が無いもの以外は規格を満足する。
- ②腐食の発生は、発生率10%以下のものは、Ni-Cr(Cr20)、 Cr_2 O₃(O₂有り)、 TiO_2 (O₂有り) 3種類である。
- ③655nm,675nm,780nm各波長でのS偏光の入射角15°での反射率を耐久試験前後で見ると、規格の95%以上を満す中間層材料は限られる。
- ④膜浮き現象に関しては、中間材料として金属系に比べ酸化物系の方が発生抑制

効果がある。

[0037]

上記②の腐食発生に関して結果の良好であった Cr_2O_3 (O_2 有り)については、反射率が初期から十分でない。図3に、 TiO_2 ((a)の曲線)、 Cr_2O_3 ((b)の曲線)の反射率の分光特性を示すように、 Cr_2O_3 は反射率が不十分である。②の腐食発生に関して結果の良好であったNi-Cr(Cr2Owt)については、膜浮き現象の発生に関して若干問題があり、さらに成膜スピードが遅く生産に適さない問題もある。

[0038]

結局、密着、腐食抑制、反射率、膜浮き現象抑制を満足し、生産性も優れている材料としては、TiO₂膜が最も良好な結果を得た。

[0039]

図4は、中間層として TiO_2 膜を用いたとき((b)の曲線:保護層 2層、(c)の曲線:保護層 3層)と従来のCr を用いたとき((a)の曲線)の入射各 15°、 S偏光の反射率の分光特性を比較した図である。これから、中間層として TiO_2 膜を用いても、従来と同等以上の反射率が得られることがわかる。

[0040]

中間層として TiO_2 膜が優れていることを確かめるために、 TiO_2 薄膜とCr 薄膜の膜表面の状態をFESEM(電界放出型走査型電子顕微鏡)で観察した。Cr 薄膜の膜表面は、図13に示すように柱状組織が見られ外部から H_2O 、 O_2 を通しやすいことが予想されるのに対し、図14に示されるように TiO_2 は 緻密な膜構造でありそのために H_2O 、 O_2 の浸入を防ぐことができるものと考えられる。

[0041]

<実施例1、2>

以上の結果を踏まえて、 TiO_2 を中間層材料として用いた金属回転多面鏡を作製してさらに検討を行った。

[0042]

実施例1および2では、図1に示すように、アルミニウム合金(A1-Mg系

)回転多面鏡基体 1 に順次、T i O_2 からなる中間層 2 を 1 0 0 n m、C u からなる最反射層 3 を 1 0 0 n m、A 1 2 O_3 からなる保護層 4 を 1 6 0 n m、S i O_2 からなる保護層 5 を 1 5 n m o p > に形成した。

[0043]

尚、この保護層4の膜厚は160nmでなくとも、例えば150nm~200 nmの範囲から適宜選ぶことができる。薄すぎると耐久性が不十分であり、厚す ぎても入射角依存性を含めた反射特性等の光学特性が不十分となる。また保護層 5の膜厚についても、15nmでなくとも、例えば10nm~20nmの範囲か ら適宜選ぶことができる。薄すぎると表面強度が低く、厚すぎても反射特性等の 光学特性が不十分となる。

[0044]

表3に、実施例1の各層の成膜条件を示し、表4に、実施例2の各層の成膜条件を示す。また、耐久試験後の腐食発生率、反射率、膜浮き発生率について評価結果を表7にまとめて示す。

[0045]

【表3】

表3(実施例1)

層	蒸着材料加熱方式	基板温度(℃)	真空度(Torr)	蒸着速度 (nm∕sec)
中間層	電子ピーム	150	1. 5×10 ⁻⁴ O ₂ 添加	0. 2
金属反射層	タングステンボー ト抵抗加熱	150	1. 0×10 ⁵	2. 0
保護層 1	電子ビーム	150	1. 5×10 ⁻⁴ O₂添加	0. 2
保護層2	電子ビーム	150	1. 5×10 ⁻⁴ O₂添加	0. 2

[0046]

【表4】

表4 (実施例2)

層	蒸着材料加熱方式	基板温度(℃)	真空度(Torr)	蒸着速度 (nm/sec)
中間層	電子ピーム	150	1. 5×10 ⁻⁴ O₂添加	0. 2
金属反射層	電子ピーム	150	1. 0×10 ⁻⁵	2. 0
保護層 1	電子ピーム	150	1.5×10 ⁻⁴ O ₂ 添加	0. 2
保護層2	電子ピーム	150	1. 5×10 ⁻⁴ O ₂ 添加	0. 2

[0047]

<実施例3、4>

実施例3および4では、図2に示すように保護層を、低屈折率/高屈折率/低屈折率の3層とした例である。アルミニウム合金(A1-Mg系)回転多面鏡基体6に順次、 TiO_2 からなる中間層7を100nm、Cuからなる金属反射層8を100nm、 $A1_2O_3$ からなる保護層9を96nm、 TiO_2 からなる保護層10を83nm、 SiO_2 からなる保護層11を15nmの厚さにそれぞれ形成した。

[0048]

尚、保護層9の膜厚は、96nmでなくとも、例えば80nm~110nmの範囲から適宜選ぶことができる。 $A1_2O_3$ 膜の膜厚が薄すぎても、また厚すぎても入射角依存性を含めた反射特性等の光学特性が不十分となる。保護層10は、83nmでなくとも例えば膜厚80nm~100nmの範囲から適宜選ぶことができる。 TiO_2 膜の膜厚が薄すぎても、また厚すぎても入射角依存性を含めた反射特性等の光学特性が不十分となる。さらに保護層11は、15nmでなくとも例えば10nm~20nmの範囲から適宜選ぶことができる。 SiO_2 膜が薄すぎると表面強度が低く、厚すぎても反射特性等の光学特性が不十分となる。

[0049]

表5に実施例3の成膜条件を示し、表6に実施例3の成膜条件を示す。また、 耐久試験後の腐食発生率、反射率、膜浮き発生率について評価結果を表7にまと めて示す。また、図4からわかるように、実施例1および2の保護層が2層の時 に比べて、実施例3、4の3層構造では500nm付近より長波長での反射率が向上している。

[0050]

【表5】

表5 (実施例3)

層	蒸着材料加熱方式	基板温度 (℃)	真空度(Torr)	燕着速度
				(nm/sec)
中間層	電子ピーム	150	1. 5×10 ⁻⁴	0. 2
			Oz添加	
金属反射層	タングステンボー	150	1. 0×10 ⁻⁵	2. 0
	卜抵抗加熱			
保護層9	電子ビーム	150	1. 5×10 ⁻⁴	0. 2
		·	Oz添加	
保護層10	電子ピーム	150	1. 5×10 ⁻⁴	0. 2
			O ₂ 添加	
保護層11	電子ビーム	150	1. 5×10 ⁻⁴	0. 2
			O ₂ 添加	·

[0051]

【表6】

表6 (実施例4)

層	蒸着材料加熱方式	基板温度 (℃)	真空度(Torr)	蒸着速度 (nm/sec)
中間層	電子ピーム	150	1. 5×10 ⁻⁴ O₂添加	0. 2
金属反射層	電子ピーム	150	1. 0×10 ⁻⁵	2. 0
保護層9	電子ビーム	150	1. 5×10 ⁻⁴ O₂添加	0. 2
保護層 10	電子ピーム	150	1. 5×10 ⁻⁴ O₂添加	0. 2
保護層11	電子ピーム	150	1. 5×10 ⁻⁴ O ₂ 添加	0. 2

[0052]

【表7】

表7

			耐久試験前			耐久試験後			l	J
実施例 NO.	腐食発生 率 (%)	膜浮き発 生率 (%)	655 nm	675 nm	780 nm	655 nm	675 nm	780 nm	密着	拭き 強度
(1)	5. 2	0. 0	96 . 1	96. 3	97. 2	96. 0	96.3	97.2	0	0
(2)	3. 3	0. 0	95. 5	96. 1	97. 1	95. 4	96.3	97.7	0	0
(3)	3. 7	0. 0	97. 5	98.0	98. 6	97. 3	97.8	98.5	0	0
(4)	4. 0	0. 0	97. 7	98. 2	98. 8	97. 5	98. 1	98.7	0	0

※耐久試験:70℃、85%RH、O₃ 1ppm、100時間

[0053]

【発明の効果】

本発明の金属回転多面鏡は、評価結果からも明らかに、表面反射率が95%以上と高く、高湿度環境において腐食の発生を抑えられ、膜浮き現象を殆ど0にすることができる。

[0054]

即ち本発明によれば、耐環境性に優れた高反射率を有する金属回転多面鏡を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施例の金属回転多面鏡の約半分を示す模式断面図である。

【図2】

本発明の実施例の金属回転多面鏡の約半分を示す模式断面図である。

【図3】

中間層の材料として、 TiO_2 ((a)の曲線)、 Cr_2O_3 ((b)の曲線)を用いたときの反射率の分光特性を示すグラフである。

【図4】

中間層としてTiO₂膜を用いたとき((b)の曲線:保護層2層、(c)の曲線:保護層3層)と従来のCrを用いたとき((a)の曲線)の入射各15°、S偏光の反射率の分光特性を比較した図である。

【図5】

腐食現象を模式的に示す説明図である。

[図6]

従来の金属回転多面鏡を高温度環境に置いた後に発生した腐食部の光学顕微鏡 写真である。

【図7】

従来の金属回転多面鏡を高湿度環境に置いた後に発生した腐食部の光学顕微鏡 写真である。

【図8】

従来の金属回転多面鏡を高温度環境に置いた後に発生した腐食部のFIB (focused ion beam)断面写真である。

【図9】

従来の金属回転多面鏡を高温度環境に置いた後に発生した「膜浮き現象」発生 個所のFIB (focused ion beam) 断面写真である。

【図10】

従来の金属回転多面鏡を高湿度環境に置いた後に発生した「膜浮き現象」発生 個所の光学顕微鏡写真である。

【図11】

従来の金属回転多面鏡を高湿度環境に置いた後に発生した「膜浮き現象」発生 個所の光学顕微鏡写真である。

【図12】

従来の金属回転多面鏡を高湿度環境に置いた後に発生した「膜浮き現象」発生 個所の光学顕微鏡写真である。

【図13】

Cr膜表面のSEM(走査型電子顕微鏡)写真である。

【図14】

TiO₂膜表面のSEM(走査型電子顕微鏡)写真である。

【符号の説明】

- 1 回転多面鏡基体 (アルミニウムまたはその合金)
- 2 中間層 (TiO₂)
- 3 金属反射層(Cu)

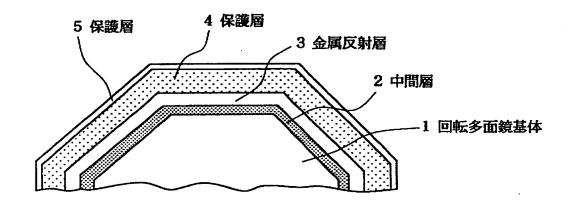
特平11-368036

- 4 保護層 (実施例1:A1₂O₃)
- 5 保護層 (実施例1:SiO₂)
- 6 回転多面鏡基体 (アルミニウムまたはその合金)
- 7 中間層 (TiO₂)
- 8 金属反射層 (Cu)
- 9 保護層 (実施例3:A1₂O₃)
- 10 保護層(実施例3:TiO₂)
- 11 保護層(実施例3:SiO₂)

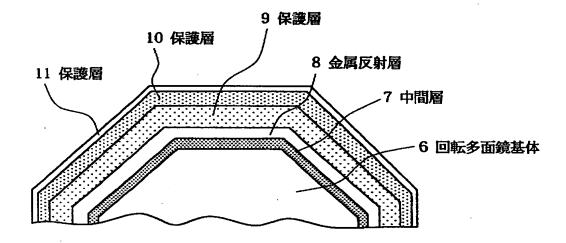
【書類名】

図面

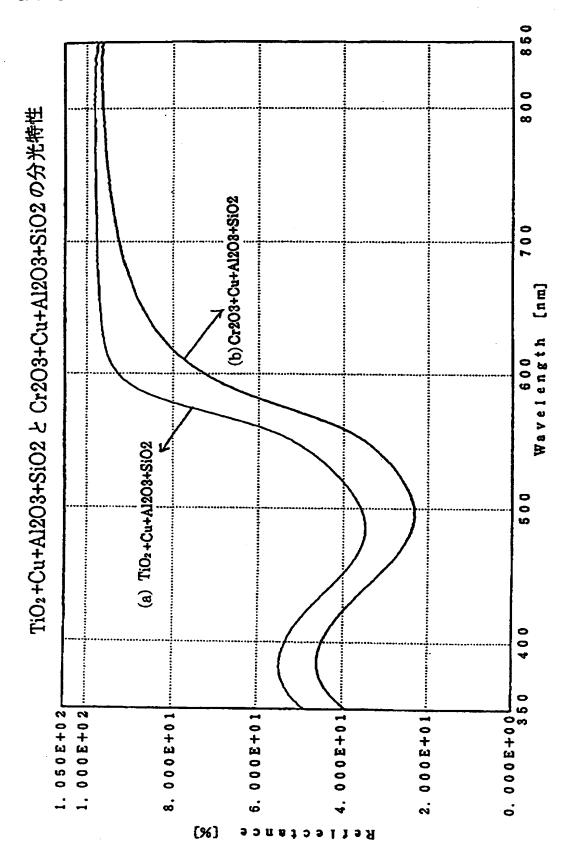
【図1】



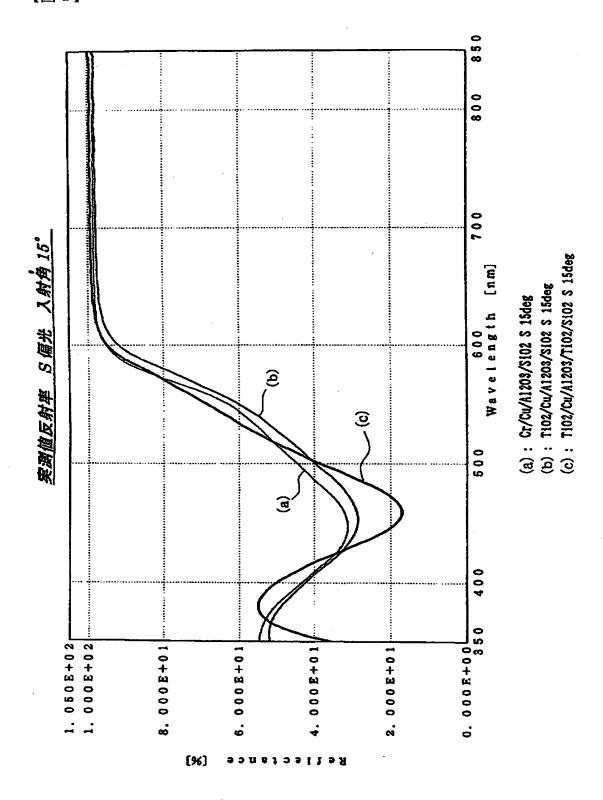
【図2】



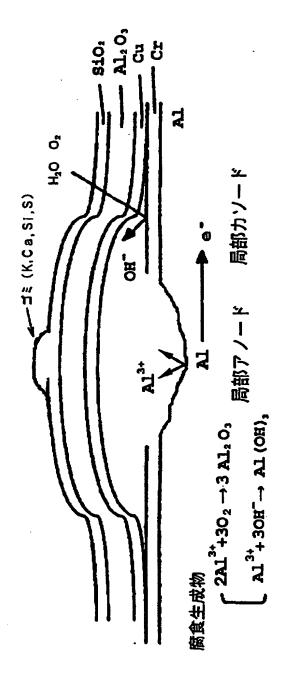
【図3】



【図4】

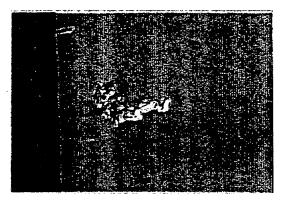


【図5】



[図6]

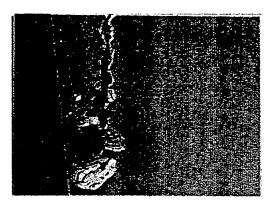
腐食部の光顕写真 ×100



光顕写真 (×100)

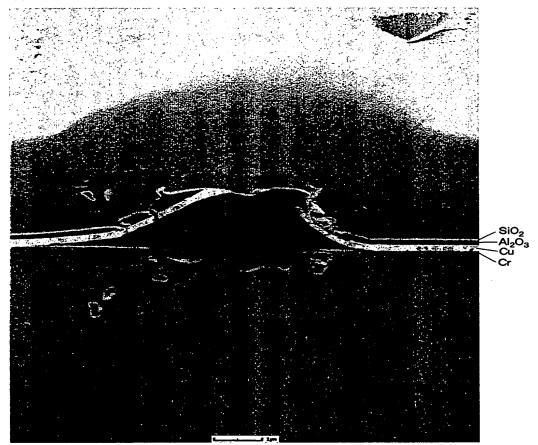
【図7】

腐食部の光顕写真 ×100



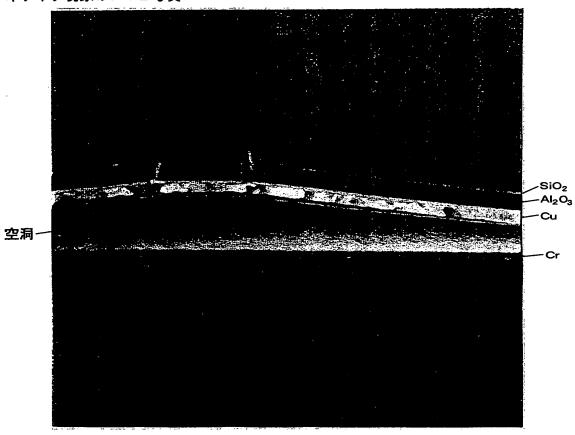
[図8]

腐食部のFIB写真



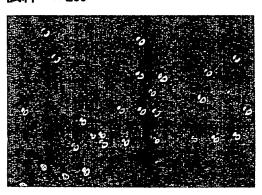
【図9】

ポチポチ現象のFIB写真



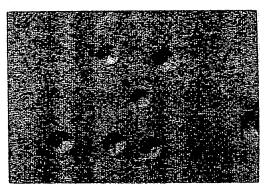
【図10】

試料 × 200



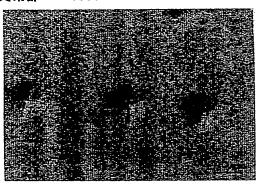
【図11】

異常部 ×500



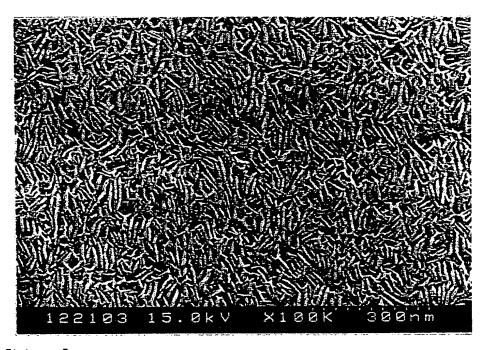
【図12】

異常部 ×1000



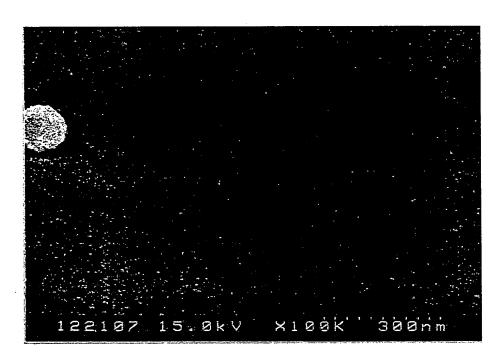
【図13】

Cr膜表面のSEM写真 ×100K



【図14】

TiO₂ 膜の表面SEM写真 ×100K



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 本発明は耐環境性に優れた高反射率を有する金属回転多面鏡を提供することを目的とする。

【解決手段】 アルミニウムまたはその合金からなる回転多面鏡基体 1 上に、T i O_2 からなる中間層 2、C u からなる金属反射層 3 を順次積層して金属回転多面鏡を形成する。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000104652]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

埼玉県秩父市大字下影森1248番地

氏 名

キヤノン電子株式会社